

CMOS/MEMS集積化デバイス技術とスマート触覚センサへの応用

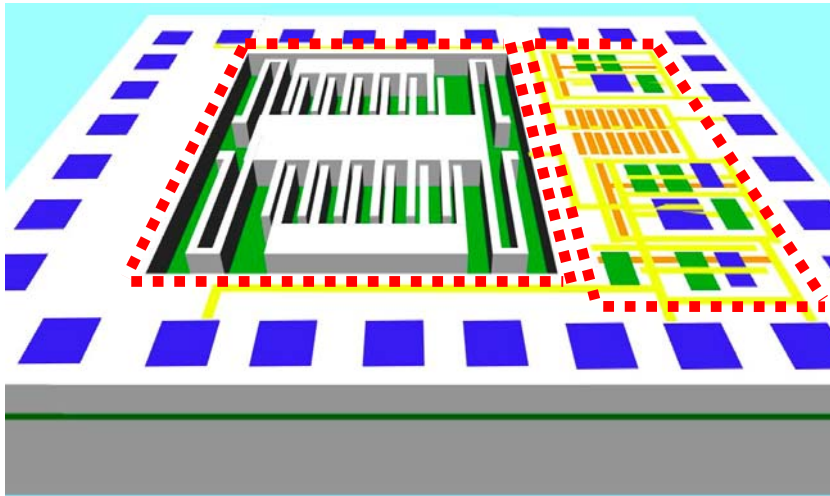
電気・電子工学系 准教授 高尾英邦

目的

CMOS回路技術とMEMSデバイス技術を融合し、新機能を発現可能な画期的デバイス集積化技術の開発

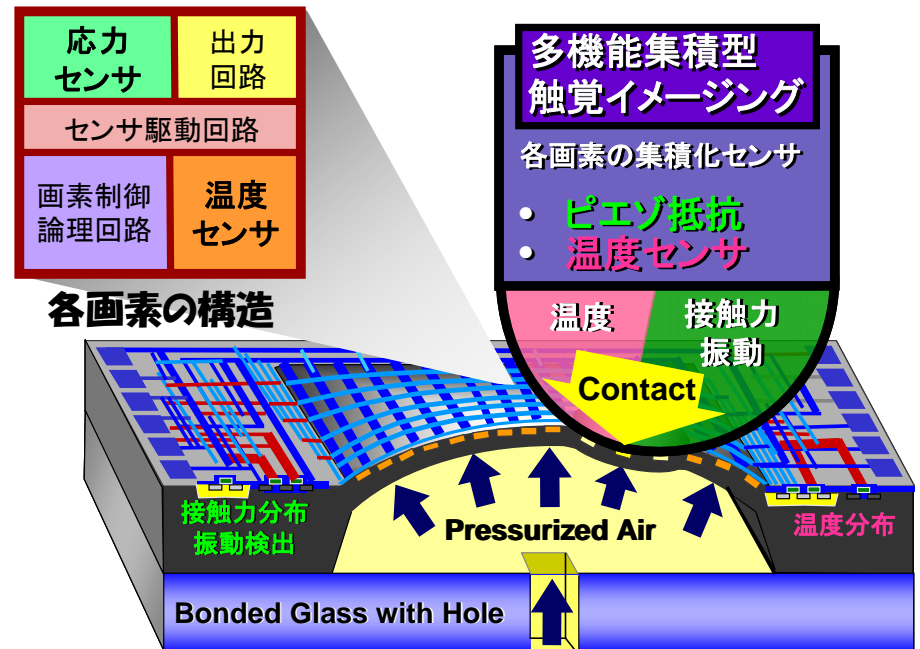
CMOS/MEMS構成、ならびに統合的センサ情報処理による人工皮膚型シリコン触覚センサ（スマート触覚）の実現

CMOS/MEMS集積化技術の例 (開発済)



IEEE MEMS2008

本研究の触覚センサ構成（一例）



H21年度計画

- **汎用性を高めたCMOS/MEMS集積化技術の確立**
- **等価性を用いたCMOS/MEMS設計環境の構築**
- **新規構成による触覚センサへの応用展開**